MENU SPARCH INDEX DETAIL BACK NEXT

3 / 5 ∢|∈⊋⊘≅

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

07-281437

(43)Date of publication of application: 27.10.1995

(51)Int.CI.

G03F 7/033 B32B 27/00 G03F 7/027

(21)Application number: 06-075872

(71)Applicant: ASAHI CHEM IND CO LTD

(22)Date of filing:

14.04.1994

(72)Inventor: MORI TORU

YOSHIDA MASAHIRO

(54) PHOTOSETTING RESIN LAMINATED BODY

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a photosetting resin laminated body useful for the production of a high-density printed circuit board having through holes of small dianaeter

CONSTITUTION: The photosetting resin layer of the photosetting resin laminated body has 20-95% transmittance for UV rays of 365nm wavelength. The thermoplastic polymer included in the photosetting resin layer contains a compd. expressed by the formula and has 110-150° C glass transition temp. This laminated body is used for the production of a printed circuit board having small—diameter through holes. In the formula, R1 is a hydrogen atom or alkyl group of 1-3 carbon number, X is a halogen atom or alkyl group of 1-3 carbon number, (n) is 0 or an integer 1 to 3 and when n>2, plural X may be same or different from each other.

$$C = CH_2$$

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-281437

(43)公開日 平成7年(1995)10月27日

(51) Int.Cl.4		識別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
G03F	7/033				N9, 15
B32B	27/00	Z	8413-4F		
G03F	7/027	502	•		N23

審査請求 未請求 請求項の数1 OL (全 14 頁)

(21)出願番号	特顧平6-75872	(71)出願人	000000033
			旭化成工業株式会社
(22)出顧日	平成6年(1994)4月14日		大阪府大阪市北区堂島浜1丁目2番6号
		(72) 発明者	森徹
			静岡県富士市鮫島2番地の1 旭化成工業
			株式会社内
		(72)発明者	吉田 正宏
			静岡県富士市鮫島2番地の1 旭化成工業
			株式会社内
		ł	
		·	

(54) 【発明の名称】 光硬化性樹脂積層体

(57)【要約】

【構成】 光硬化性樹脂層が、波長365 n m の紫外線 に対して20~95%の透過率を有し、該光硬化性樹脂 層に含まれる熱可塑性高分子が、式(1)に示される化 合物を含みかつガラス転移温度が110~150°Cであ ることを特徴とする光硬化性樹脂積層体、およびこれを 用いて小径スルーホールを持つプリント配線板を製造す る方法。

(化1)

$$\begin{array}{c}
R_1 \\
C = CH_2 \\
\hline
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
(X)n \\
\end{array}$$

(式中のR、は水素原子または炭素数1~3のアルキル 基、Xはハロゲン原子または炭素数1~3のアルキル 基、nは0または1~3の整数であってnが2以上の場 合、複数のXはたがいに同一であっても異なっていても 良い)

【効果】 本発明の光硬化性樹脂積層体は、小径スルー ホールを有する高密度プリント配線板の製造に有用であ

【特許請求の範囲】

【請求項1】 支持層と、その一方の面に設けられた、 波長365nmの紫外線に対して20~95%の紫外線 透過率を有し、かつ(a) α 、 β - 不飽和カルボン酸の 中から選ばれる少なくとも1種の第1単量体15~40 重量%、下記式(1)に示される化合物の中から選ばれ る少なくとも1種の第2単量体5~35重量%、

(化1)

$$\begin{array}{c|c}
R_1 \\
C = CH_2
\end{array}$$

$$(X)n \qquad \qquad \vec{x} (1)$$

(式中のR、は水素原子または炭素数1~3のアルキル 基、Xはハロゲン原子または炭素数1~3のアルキル 基、nは0または1~3の整数であってnが2以上の場 合、複数のXはたがいに同一であっても異なっていても 良い) および、炭素数1~6のアルキル基を有するアル キル(メタ)アクリレート、炭素数2~6のヒドロキシ 20 アルキル基を有するヒドロキシアルキル(メタ)アクリ レート、(メタ)アクリロニトリル、(メタ)アクリル アミドとその窒素上の水素が炭素数1~4のアルキル基 または炭素数1~6のアルコキシ基で置換された化合 物、およびメタクリル酸グリシジルの中から選ばれる少 なくとも1種の第3単量体20~75重量%、をビニル 共重合して得られる重量平均分子量30,000から1 00、000でガラス転移温度が110~150℃の1 種または2種以上の熱可塑性高分子30~70重量部、 (b) 1分子中に1個以上のエチレン性不飽和基を有す 30 る1種または2種以上の光重合性化合物30~70重量 部、および(c)1種または2種以上の光重合開始剤 0.01~20重量部を主成分とする光硬化性樹脂層と

【発明の詳細な説明】

からなる光硬化性樹脂積層体。

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は光硬化性樹脂積層体に関 する。さらに詳しくは小径スルーホールを持つプリント 配線板の製造に適した新規な光硬化性樹脂積層体に関す る。

[0002]

【従来の技術】スルーホールを持つプリント配線板の製 造には、テンティング法と呼ばれる方法が多く使われて いる。テンティング法は、支持体と光硬化性樹脂層から なる、いわゆるドライフィルムレジスト(以下DFRと 略記する)を用いて行われる。テンティング法は、DF Rの光硬化性樹脂層で、金属被覆絶縁板(以下基板と略 記する) の各貫通孔の両端開口部をカバーした後、配線 パターンマスク等を通し露光することにより、貫通孔を 覆う硬化レジスト (テンティング膜と呼ばれる)を形成 50 し、さらに基板表面に付着することにより不良基板の発

させ、現像液により未露光部分の光硬化性樹脂層の除去 後、硬化レジスト画像以外のととろの基板上の金属導体 層をエッチングすることによりスルーホールを有するプ リント配線板を製造する方法である。

【0003】とこで貫通孔を覆うように形成された硬化 レジスト層は、スルーホールの周囲に形成される導体層 (以下ランドと称する) 表面に接着することにより保持 され、エッチング液が貫通孔内に入り込むことを防いで いる。したがって、テンティング法においては、ランド 10 を作ることは設計上不可欠で、その幅は0.5mm前後

【0004】しかしながら、近年プリント配線板の高密 度化が進み、従来よりも小さな直径の小径スルーホール とより狭いランドが多用されるようになった。小径スル ーホールは、直径が0.5mm以下であり、ランド幅は 1 mm以下、好ましくは0.05 mm以下である。 ランド幅が狭いと小径貫通孔を覆う硬化レジスト膜の基 板への接着が十分でなく、小径貫通孔内へのエッチング 液のしみこみによる不良が多発し、実質的に製造が不可 能である。従って、従来はテンティング法よりも工程が 複雑・高コストである穴埋めインク法やめっき法を使わ ざる得なかった。

【0005】とれに対して、DFRの光硬化性樹脂層を 小径貫通孔内に一定深さまで埋め込ませ、かつ十分光硬 化させると、ランド幅以上にマスクと貫通孔の位置がず れた場合でも良好なテンティング膜が形成され、小径ス ルーホールを持つプリント配線板の製造が従来のテンテ ィングプロセスでも可能となる技術が知られている(特 開平3-236956公報)。とれは「埋め込みテンテ ィング法」として実用化され広まった。

【0006】「埋め込みテンティング法」は特開平3-236956公報に開示されているように、ラミネート 速度を遅くすると光硬化性樹脂層が貫通孔へ深く埋め込 まれ、より効果を発揮するため、遅い速度でラミネート する場合が多かった。しかしながら、ラミネート装置の 一部は従来のテンティング法の通常ラミネート速度に適 合するように設計されているため、「埋め込みテンティ ング法」に使用できないという制約があった。また、 「埋め込みテンティング法」の利用が拡大するにつれ

40 て、ラミネート工程に関わる所要時間の短縮が求められ てきた。

【0007】DFRにあっては、特開平3-23695 6公報に開示されているように粘度が低くなるに従い、 光硬化性樹脂層の貫通孔への埋め込みが大きくなり、よ り効果がでるが、一方で耐コールドフロー性、すなわ ち、巻取りロールを保存する際、光硬化性樹脂層がロー ル端面から染み出さないことも要求される。染みだし (エッシヒュースと呼ばれる) た光硬化性樹脂層は ラ ミネートの際にチップとなって飛び散り作業環境を汚染

3

生を引き起とし、実用上非常に大きな問題となる。 【0008】

【発明が解決しようとする課題】小径スルーホールを持つプリント配線板製造において、ラミネート速度条件をより高速化しても、光硬化性樹脂層が「埋め込みテンティング法」として効果を発揮する深さまで貫通孔内へ埋め込まれ、しかも耐コールドフロー性を満足する光硬化性樹脂積層体の開発を課題とする。

[0009]

【課題を解決するための手段】上記の課題を解決すべく 検討を重ねた結果、特定の紫外線透過率を持つ光硬化性 樹脂層の中で、光硬化性樹脂層に含まれる熱可塑性高分子として特定の高分子を選ぶことにより、従来のテンティング法における通常ラミネート速度(2~3 m/分) でも光硬化性樹脂層が「埋め込みテンティング法」として効果を発揮する深さまで埋め込まれ、マスクと基板の 貫通孔との位置がずれた場合でも良好なテンティング膜を形成させ、しかも耐コールドフロー性を有することを 見出した。

【0010】すなわち本発明は、支持層と、その一方の 20 面に設けられた、波長365nmの紫外線に対して20 ~95%の紫外線透過率を有し、かつ(a)α、β-不 飽和カルボン酸の中からから選ばれる少なくとも1種の 第1単量体15~40重量%、下記式(1)に示される 化合物の中から選ばれる少なくとも1種の第2単量体5~35重量%

[0011] [化2]

$$\begin{array}{c}
R_1 \\
C = CH_2
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
(X)n \\
\overrightarrow{x} (1)
\end{array}$$

【0012】(式中のR、は水素原子または炭素数1~3のアルキル基、Xはハロゲン原子または炭素数1~3のアルキル基、nは0または1~3の整数であってnが2以上の場合、複数のXはたがいに同一であっても異なっていても良い)および、炭素数1~6のアルキル基を40有するアルキル(メタ)アクリレート、炭素数2~6のヒドロキシアルキル基を有するヒドロキシアルキル(メタ)アクリレート、(メタ)アクリレート、(メタ)アクリレート、(メタ)アクリレート、(メタ)アクリロニトリル、(メタ)アクリルアミドとその窒素上の水素が炭素数1~4のアルキル基または炭素数1~6のアルコキシ基で置換された化合物、およびメタクリル酸グリシジルの中から選ばれる少なくとも1種の第3単量体20~75重量%、をビニル共重合して得られる重量平均分子量30、000から100、000でガラス転移温度が110~150℃の1種または2種以上の執可塑性高分子30~50

70重量部、(b) 1分子中に1個以上のエチレン性不飽和基を有する1種または2種以上の光重合性化合物30~70重量部、および(c) 1種または2種以上の光重合開始剤0.01~20重量部を主成分とする光硬化性樹脂層とからなる光硬化性樹脂積層体に関する。

【0013】本発明の光硬化性樹脂積層体は、特に直径 が0.5mm以下、ランド幅が0.1mm以下の小径ス ルーホールを持つプリント配線板を製造する際のレジス ト膜として有用である。本発明の光硬化性樹脂積層体を 小径貫通孔を有する基板の両面に3m/分以下の速度で 積層し、基板の両側から露光後、エッチングにより得ら れる硬化レジスト層は、マスクのずれにより実質的にラ ンドが形成されなかった部分においてもエッチング液の 貫通孔内へのしみとみが無い正常な小径スルーホールが 得られる。したがって、本発明の光硬化性樹脂積層体を 用いることにより、従来のテンティング法では歩留りの 良い製造が難しかった小径スルーホールを有するプリン ト配線板が、従来のテンティング法に用いられる通常の ラミネート速度で製造可能となるために、特別な仕様の ラミネーターでなくとも製造可能となり、しかもラミネ ート作業時間が短縮される。

【0014】本発明の光硬化性樹脂積層体を構成する光硬化性樹脂層の波長365nmにおける紫外線透過率(以下、"365nm透過率"と略記する)は、20~95%であることが必要である。より好ましくは25~60%である。365nm透過率が20%より低いとランドが無い部分において十分なテンティング膜強度が得られず、エッチング液のしみこみを生ずるようになる。一方、365nm透過率が95%以上より大きいと、路30光時間が長くかかり生産性の点で不利となる。

【0015】との光硬化性樹脂層が特定のビニル共重合体からなる熱可塑性高分子を含有するととにより、3m/分以下の幅広い範囲のラミネート速度でも、小径貫通孔に所定深さまで埋め込まれる光硬化性樹脂積層体が実現可能となった。本発明においては、光重合性樹脂層は、前記熱可塑性高分子(a)、1分子中に1個以上のエチレン不飽和基を有する1種または2種以上の光重合性化合物(b)、および1種または2種以上の光重合開始剤(c)を主成分とするものである。

[0016] 熱可塑性高分子としては、下記第 $1\sim3$ 単量体をビニル共重合して得られるものが使用される。第1 単量体としては、 α 、 β -不飽和カルボン酸 $15\sim4$ 0 重量%、好ましくは $20\sim3$ 0 重量%が用いられる。15 重量%より少ないと、アルカリ水溶液による現像が困難になる。40 重量%より多いと、重合中に溶媒に不溶となるため合成できなくなる。

選ばれる少なくとも1種の第3単量体20~75重量 [0017] 具体例としては、(メタ)アクリル酸、フ%、をビニル共重合して得られる重量平均分子量30、 マル酸、ケイ皮酸、クロトン酸、イタコン酸、マレイン 000から100、000でガラス転移温度が110~ 酸半エステル等であり、それぞれ単独で用いてもよい。 150℃の1種または2種以上の熱可塑性高分子30~ 50 し、2種以上を組み合わせて用いてもよい。特にメタク

リル酸が好ましい。共重合させる第2単量体として、前 記式(1)に示される化合物5~35重量%、好ましく は15~30重量%が用いられる。5重量%より少ない と、耐コールドフロー性が低下し、エッジヒューズが激 しく製品としての保存が困難になる。35重量%より多 いと、共重合中に溶媒に対する溶解性が低下し重合が完 結しにくい上、光硬化性樹脂層の現像時間が著しく長く なる。

【0018】具体例としては、スチレン、αーメチルス チレン、p-メチルスチレン、p-クロロスチレン等で 10 ルドフロー性を良好にすると90℃の粘度が大きくな あり、それぞれ単独で用いてもよいし、2種以上を組み 合わせて用いてもよい。特にスチレンが好ましい。さら に共重合させる第3単量体としては、炭素数1~6のア ルキル基を有するアルキル(メタ)アクリレート、炭紫 数2~6のヒドロキシアルキル基を有するヒドロキシア ルキル(メタ)アクリレート、(メタ)アクリロニトリ ル、(メタ)アクリルアミドとその窒素上の水素が炭素 数1~4のアルキル基または炭素数1~6のアルコキシ 基で置換された化合物、およびメタクリル酸グリシジル の中から選ばれる少なくとも1種の化合物20~75重 20 量%、好ましくは45~65重量%が用いられる。20 重量%より少ないと、光硬化性樹脂層の可撓性が低下す る。75重量%より多いと、耐コールドフロー性が低下 する。

【0019】具体例としては、(メタ)アクリル酸メチ ル、(メタ) アクリル酸エチル、(メタ) アクリル酸n-プロビル、(メタ) アクリル酸-iso-プロビ ル、(メタ)アクリル酸-n-ブチル、(メタ)アクリ ル酸-sec-プチル、(メタ)アクリル酸-tert ブチル、(メタ)アクリル酸-2-エチルヘキシル、 (メタ) アクリル酸-2-ヒドロキシエチル、(メタ) アクリル酸-2-ヒドロキシプロビル、(メタ)アクリ ルアミド、N-メチロールアクリルアミド、N-ブトキ シメチルアクリルアミド、(メタ) アクリロニトリル、 (メタ) アクリル酸グリシジル等であり、それぞれ単独 で用いてもよいし、2種以上を組み合わせて用いてもよ い。特にメタクリル酸メチルが好ましい。

【0020】熱可塑性高分子の重量平均分子量は、3 0、000から100、000であり、好ましくは3 0、000から60、000である。重量平均分子量 は、ゲルバーミエーション クロマトグラフィー (GP C) により標準ポリスチレンの検量線を用いて測定した 値である。30、000より小さいと、光硬化性樹脂層 が脆くなり、ラミネート時のフィルム切断において切断 部周辺に微細な割れが発生し使用に適さない。100、 000より大きいと、現像性が悪化する。

【0021】熱可塑性高分子のガラス転移温度は、11 0~150℃でなければならない。好ましくは115~ 140℃である。ガラス転移温度は、共重合体中に含ま

oxの式においてのみ単位は絶対温度 K) および各単 量体の重量分率(wn)から、下記Foxの式により求 められる。

1/Tg (共重合体) = w1/Tg1+w2/Tg2+···+wn/Tgn

ガラス転移温度が110°Cより低いと、90°Cにおける 粘度が本発明の範囲に入ることと、耐コールドフロー性 との両方を満たすことができない。つまり、90°Cの粘 度を小さくするとコールドフローが大きくなり、耐コー り、埋め込みが小さくなる。ガラス転移温度が150℃ より高いと溶解性が低下し、均一な光硬化性樹脂組成物 ができない。

【0022】光硬化性樹脂層に含有される熱可塑性高分 子の量は、1種または2種以上の混合であってもよい が、総量として30~70重量部の範囲であり、好まし くは40~60重量部である。30重量部より少ない と、耐コールドフロー性が低下する。70重量部より多 いと、光硬化性樹脂層が脆くなる。熱可塑性高分子は、 第1~3単量体の混合物を、アセトン、メチルエチルケ トン、イソプロバノール等の溶剤で希釈した溶液に、過 酸化ベンゾイル、アゾビスイソブチロニトリル等のラジ カル重合開始剤を適量添加し、加熱撹拌することにより 合成するととが好ましい。混合物の一部を反応液に滴下 しながら合成する場合もある。また、反応終了後さらに 溶剤を加えて、所望の濃度に調製する場合もある。溶液 重合以外にも、塊状重合、懸濁重合および乳化重合でも 合成可能である。

【0023】光硬化性樹脂層の成分の1つである1分子 30 中に1個以上のエチレン性不飽和基を有する光重合性化 合物は、30~70重量部、好ましくは40~60重量 部用いられる。30重量部より少ないと、硬化が十分で なくレジストとしての強度が不足する。70重量部より 多いと、剥離時間が長くなる。との化合物の具体例とし ては、2-ヒドロキシ-3-フェノキシプロピルアクリ レート、フェノキシテトラエチレングリコールアクリレ ート、β-ヒドロキシプロビル-β' - (アクロイルオ キシ)プロビルフタレート、1,4-テトラメチレング リコールジ (メタ) アクリレート、1,6-ヘキサンジ 40 オールジ (メタ) アクリレート、1、4-シクロヘキサ ンジオールジ (メタ) アクリレート、オクタプロピレン グリコールジ (メタ) アクリレート、グリセロール (メ タ) アクリレート、2 -ジ (p -ヒドロキシフェニル) プロパンジ (メタ) アクリレート、グリセロールトリ (メタ) アクリレート、トリメチロールプロパントリ (メタ) アクリレート、ポリオキシプロビルトリメチロ ールプロパントリ (メタ) アクリレート、ポリオキシエ チルトリメチロールプロパントリ (メタ) アクリレー ト、ジベンタエリスリトールベンタ(メタ)アクリレー れる単量体の単独重合体のガラス転移温度(Tgn:F 50 ト、ジベンタエリスリトールヘキサ(メタ)アクリレー

ト、トリメチロールプロパントリグリシジルエーテルト リ(メタ)アクリレート、ビスフェノールAジグリシジ ルエーテルジ (メタ) アクリレート、シアリルフタレー ト、ポリエチレングリコールジ(メタ)アクリレート、 ポリプロビレングリコールジ (メタ) アクリレート、ビ ス(ポリエチレングリコール(メタ)アクリレート)ポ リプロピレングリコール、4-ノルマルオクチルフェノ キシベンタプロピレングリコールアクリレート等があ る。また、ヘキサメチレンジイソシアナート、トリレン ジイソシアナートなどの多価イソシアナート化合物と、 2-ヒドロキシプロピル (メタ) アクリレートなどのヒ ドロキシアクリレート化合物とのウレタン化反応物など が挙げられる。それぞれ単独で用いてもよいし、2種以 上を組み合わせて用いてもよい。

【0024】光重合開始剤は、0.01~20重量部、 好ましくは1~10重量部用いられる。0.01重量部 より少ないと感度が十分ではない。20重量部より多い と、365nm透過率が20%以上にすることが難し い。光重合開始剤の種類と量は、光硬化性樹脂層の36 れる。365nmの紫外線に対して吸収の大きい光重合 開始剤を用いる場合は、添加量を少なくする。逆に吸収 の小さい光重合開始剤を用いる場合は、添加量を多くす。

【0025】好ましい光重合開始剤の例としては下記式 (2) (3) および(4) で示される化合物を挙げる ととができる。

[0026]

(化3)

$$\begin{array}{c|c}
 & C & R_2 \\
 & C & C \\
 & R_2 \\
 & C & R_2
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
 & \exists (2)$$

【0027】[R, 、R, はおのおの独立的に水素、水 酸基、アルキル基、アルコキシ基またはフェノキシ基を 示すが、R、、R、が同時に水酸基であることはない〕 具体例としては、ベンジルジメチルケタール、ベンジル ジエチルケタール、ベンジルジプロピルケタール、ベン ジルジフェニルケタール、ベンゾインメチルエーテル、 ベンゾインエチルエーテル、ベンゾインピロピルエーテ 40 キソー3-フェニルプロピオン酸エチルー2-(o-ベ ル、ベンゾインフェニルエーテルなど挙げることができ る。

[0028]

(£4)

アルキル基またはハロゲン]

具体例としては、チオキサントン、2、4-ジメチルチ オキサントン、2、4-ジェチルチオキサントン、2-イソプロビルチオキサントン、4-イソプロビルチオキ サントン、2, 4ージイソプロピルチオキサントン、2 ーフルオロチオキサントン、4 ーフルオロチオキサント ン、2-クロロチオキサントン、4-クロロチオキサン トン、1-クロロ-4-プロポキシチオキサントンなど を挙げるととができる。

10 [0030]

[化5]

$$R_4R_5N$$
 — COOR₆ $\equiv t$ (4)

【0031】 [式中、R、及びR、は炭素数3以下のア ルキル基、R。は水素または炭素数18以下のアルキル

具体例としては、pージメチルアミノ安息香酸、pージ エチルアミノ安息香酸及びp-ジイソプロビルアミノ安 5 n m透過率を20~95%の範囲にするように選択さ 20 息香酸及びこれらと下記のアルコールのエステル化物が 挙げられる。アルコールとしては、メチルアルコール、 エチルアルコール、プロピルアルコール、イソプロピル アルコール、ブチルアルコール、イソブチルアルコー ル、sec-ブチルアルコール、tert-ブチルアル コール、カーアミルアルコール、イソアミルアルコー ル、ヘキシルアルコール、オクチルアルコール等を挙げ るととができる。

> 【0032】また、とれらの開始剤に加えて、公知のあ ちゆる化合物を用いることができる。例えば、ベンゾフ 30 ェノン、4,4'-ビス(ジメチルアミノ)ベンゾフェ ノン [ミヒラーズケトン]、4、4'ービス(ジエチル アミノ) ベンゾフェノンなどの芳香族ケトン類、2-(o-クロロフェニル)-4.5-ジフェニルイミダゾ リル二量体等のビイミダゾール化合物、9-フェニルア クリジン等のアクリジン類、α、αージメトキシーαー モルホリノーメチルチオフェニルアセトフェノン、2. 4, 6-トリメチルベンゾイルホスフォンオキシド、フ ェニルグリシン、さらに1-フェニル-1、2-プロバ ンジオン-2-0-ベンゾイルオキシム、2.3-ジオ ンゾイルカルボニル)-オキシム等のオキシムエステル 類がある。

【0033】光硬化性樹脂の熱安定性、保存安定性を向 上させるために、光硬化性樹脂層にラジカル重合禁止剤 を含有させるととは好ましいことである。例えば、p-メトキシフェノール、ハイドロキノン、ピロガロール、 ナフチルアミン、tert‐ブチルカテコール、塩化第 一銅、2.6-ジーtert‐ブチルーp-クレゾー ル、2、2'-メチレンピス(4-エチル-6-ter 【0029】[式中、Y及びZは水素、炭素数4以下の 50 t - ブチルフェノール)、2,2 ーメチレンビス(4)

10

- メチル-6-tert-ブチルフェノール) 等があ

【0034】光硬化性樹脂層は染料、顔料等の着色物質 を含有してもよい。例えばフクシン、フタロシアニング リーン、オーラミン塩基、カルコキシドグリーンS、パ ラマジエンタ、クリスタルバイオレット、メチルオレン ジ、ナイルブルー2 B、ビクトリアブルー、マラカイト グリーン、ベイシックブルー20、ダイヤモンドグリー ン等がある。

【0035】また、光照射により発色する発色系染料を 10 含有しても良い。発色系染料としては、ロイコ染料とハ ロゲン化合物の組み合わせが良く知られている。ロイコ 染料としては、例えばトリス(4-ジメチルアミノー2 -メチルフェニル) メタン [ロイコクリスタルバイオレ ット]、トリス(4ージメチルアミノー2ーメチルフェ ニル) メタン [ロイコマラカイトグリーン] 等が挙げら れる。一方ハロゲン化合物としては臭化アミル、臭化イ ソアミル、臭化イソブチレン、臭化エチレン、臭化ジフ ェニルメチル、臭化ベンザル、臭化メチレン、トリブロ モメチルフェニルスルホン、四臭化炭素、トリス(2, 3-ジプロモプロピル) ホスフェート、トリクロロアセ トアミド、ヨウ化アミル、ヨウ化イソブチル、1、1、 1-トリクロロ-2, 2-ビス(p-クロロフェニル) エタン、ヘキサクロロエタン等がある。

【0036】さらに光硬化性樹脂層は、必要に応じて可 塑剤等の添加剤を含有しても良い。例えばジエチルフタ レート等のフタル酸エステル類が例示できる。光硬化性 樹脂層は、90°Cにおける粘度が5×10°~5×10 * ポイズであることが好ましく、さらに好ましくは10 '~10'ボイズ、最も好ましくは10'~10'ボイ 30 ズである。90°Cにおける粘度が小さいことにより、3 m/分以下の幅広い範囲のラミネート速度でも、小径貫 通孔に所定深さまで埋め込むととができる。粘度が5× 10' ボイズより大きいと、光硬化性樹脂層の小径貫通 孔内への埋め込み性が低下する。一方粘度が低くなるに したがい、光硬化性樹脂層は小径貫通孔の中へ埋め込ま れやすくなるが、耐コールドフロー性が悪化する。5× 10' ボイズ未満では、製品の長期にわたるロール形状 保持ができなくなる。

の範囲から選ばれるが、好ましい範囲は35~70μm である。厚みが30μmより薄いと、貫通孔開口部の光 硬化性樹脂層のテンティング膜が現像時に膨潤したり破 れを起こしやすくなり、また貫通孔内に埋め込まれる光 硬化性樹脂層の深さが十分でなく信頼性が低下する。一 方、厚みが100μmより厚いと、波長365nm透過 率を20%以上に保つことが難しく、解像性も悪くなる ため好ましくない。

【0038】光硬化性樹脂積層体の支持層としては、活 性光を透過する透明なものが望ましい。例えば、ポリエ 50 ネート速度等を適切に設定する必要がある。一般的に、

チレンテレフタレートフィルム、ポリピニルアルコール フィルム、ポリ塩化ビニルフィルム、塩化ビニル共重合 体フィルム、ボリ塩化ビニリデンフィルム、塩化ビニリ デン共重合体フィルム、ポリメタクリル酸メチル共重合 体フィルム、ポリスチレンフィルム、ポリアクリロニト リルフィルム、スチレン共重合体フィルム、ポリアミド フィルム、セルロース誘導体フィルム等が挙げられる。 これらのフィルムは必要に応じ延伸されたものも使用可 能である。

【0039】支持層の一方の面に光硬化性樹脂層を積層 したのち、光硬化性樹脂層表面に必要に応じて保護層を 積層する。との保護層の重要な特性は、光硬化性樹脂層 との密着力について、支持層よりも保護層の方が充分小 さく容易に剥離できることである。例えばポリエチレン フィルム、ポリプロピレンフィルム等がある。また、特 開昭59-202457号公報に示された剥離性の優れ たフィルムを用いることもできる。

【0040】本発明の光硬化性樹脂積層体は、小径スル ーホールを持つプリント配線板製造における「埋め込み 20 テンティング法」に使用できる。すなわち、本発明の光 硬化性樹脂積層体は、貫通孔を持つ金属被覆絶縁板に光 硬化性樹脂積層体をラミネートし、露光、現像、エッチ ングすることにより小径スルーホールを持つプリント配 線板を製造する方法において、該光硬化性樹脂積層体を ラミネートする際に、貫通孔の内周縁から貫通孔内壁に 沿って該内壁上に延びる光硬化性樹脂層の埋め込みの深 さを、該深さの金属被覆絶縁板の各面の金属導体層の厚 さに対し、0.3以上とする方法に用いる場合、優れた 効果を発揮する。

【0041】本発明の光硬化性樹脂積層体を金属被覆絶 縁板の両面に積層し、貫通孔内部に埋め込ませる工程に おいて、貫通孔の内周縁から貫通孔内壁に沿って該内壁 面上に延びる光硬化性樹脂層の埋め込みの深さが、該深 さの金属被覆絶縁板の各面の金属導体層の厚さに対し 0. 3以上とは、図1において、貫通孔内周縁から内壁 上に延びる光硬化性樹脂層の深さdを、絶縁板の両面に 形成された導体層厚みtで割った値が0.3以上である ととをいう。0.5以上がさらに好ましく、1.1以上 が最も好ましい。との値が大きいほど、大きなずれ幅に ${0037}$ 光硬化性樹脂層の厚みは ${30} \sim {100} \mu m$ 40 対しても欠陥が生じにくく好ましいが、 ${20} \perp {100} \mu m$ 以上の効果の増加は認められず、またエッチング後の硬 化レジスト層の剥離時間が長くなって生産性が低下す る。0. 3より小さいと従来のテンティング法との有意 な差が無くなる。

> 【0042】本発明の光硬化性樹脂積層体の基板への積 **層方法は、従来のテンティング法で使用されているホッ** トロールラミネーターあるいは真空ラミネーターを用い ることができるが、貫通孔の内周縁から内壁上に埋め込 ませるために、ラミネーターのロール温度、圧力、ラミ

より深く光硬化性樹脂層を埋め込ませるためには、ロー ル温度および圧力を上げ、ラミネート速度を遅くすると 効果がある。さらに特開平3-236956公報に開示 されているように2段式ホットロールラミネーターを用 いるとさらに好ましい。

【0043】露光は、配線として残したい部分および導 電性貫通孔の開口部の被覆として残したい部分が透明な 高透過性マスクを通し、超高圧水銀灯などの紫外線を用 いて行われる。現像は、アルカリ水溶液を用いて未露光 リウム、炭酸カリウム、水酸化ナトリウム、水酸化カリ ウム等の水溶液を用いる。最も一般的には0.5~3% の炭酸ナトリウム水溶液が用いられる。

[0044] エッチングは酸性エッチング、アルカリエ ッチングなど、使用するDFRに適した方法で行うこと ができる。エッチング後の光硬化レジストの剥離は、現 像で用いたアルカリ水溶液よりもさらに強いアルカリ性 の水溶液により剥離される。例えば、 $1\sim5\%$ の水酸化 ナトリウムまたは水酸化カリウムの水溶液を用いる。

【実施例】以下、実施例により本発明をさらに詳しく説 明するが、本発明の範囲は、実施例に限定されるもので はない。以下の実施例中の「部」はすべて「重量部」で ある。実施例中の諸特性は、次の方法により測定した。

1)分子量

日本分光製ゲルパーミエーションクロマトグラフィーに よりポリスチレン換算の重量平均分子量として求めた。 2) 粘度

島津製作所製フローテスターCFT-500を用いた。 3) 紫外線透過率

島津製作所製UV分光計UV-240で、測定側にポリ エチレンテレフタレートフィルムと光硬化性樹脂層の積 層体を置き、リファレンス側にポリエチレンテレフタレ ートフィルムを置き、T%モードにより測定した。

4) ガラス転移温度(Tg)

Foxの式に当てはめ、算出した。

5) コールドフロー性の評価

〔プレスフロー試験〕光硬化性樹脂層積層体を2.5c m角に切り、保護フィルム (ポリエチレンフィルム)を 剥がし、ポリエチレンテレフタレートフィルム10cm 40 1と、光重合性化合物、光重合開始剤およびその他の成 角の中央にはさみ、40°Cに加熱した油圧プレスにより*

P-1 (36%MEK溶液)

144重量部

ノナエチレングリコールジアクリレート (M-1) 10重量部 ヘキサメチレンジイソシアネートとオリゴプロピレングリコールモノメタクリ

レートとのウレタン反応物(M-2)

無水フタル酸と2-ヒドロキシプロビルアクリレートとの半エステル化物とプ ロビレンオキシドとの反応物(M-3:日本触媒化学社製OE-A200)

10重量部

ベンジルジメチルケタール(I-1)

5重量部

2、4-ジェチルチオキサントン(1-2)

0.3重量部

*100kgの力を5分間加え、レジストの4方向でのは み出し幅を測定し、その平均値を求めた。

12

【0046】 この値が0.8mm以上であると、ロール 状にして保存した場合に、ロールの端面にエッジヒュー ズが発生し、実質的にラミネーターにより基板に安定し て積層する事ができなくなるととが分かっている。

6) 光硬化性樹脂層の貫通孔内周縁から内壁上への埋め 込み深さ(以下、単に「埋め込み深さ」と略記する) 現像後の基板をエポキシ樹脂により包埋硬化し、貫通孔 部を現像除去する。アルカリ水溶液としては、炭酸ナト 10 が現れるまで研磨し、光学顕微鏡で基板表面から内壁上 に延びた長さdを測定した。(図1)

> 7) 小径スルーホールの開□部被覆保持率 エッチング後、光学顕微鏡により開口部被覆を観察し、 破れの有無を確認した。

【0047】A:テンティング膜が完全に小径スルーホ ールの開口部を被覆しており、エッチング液のスルーホ ール内への染み込みが無いホール数

B:観察ホール全数

開□部被覆保持率(%)=(A/B)×100

[0048]

【合成例】かきまぜ器、還流冷却器、温度計を備えた2 リットル容のセパラブルフラスコに、メチルエチルケト ン (MEK) 350 gを入れ、窒素気流下、80℃でか きまぜながら単量体としてメタクリル酸100g、スチ レン100g、メタクリル酸メチル160g、メタクリ ル酸-2-ヒドロキシエチル40g、重合開始剤として アゾビスイソプチロニトリル4gの均一混合物を4時間 かけて滴下した。8時間加熱・撹拌し、アゾビスイソブ チロニトリル3gをMEK溶液として加え、さらに12 30 時間加熱・撹拌した。最後にMEK400gを加えて、 溶液濃度を35%前後に調整し、目的の熱可塑性高分子 (P-1)を得た。分子量は4.8万、Tgは130℃ であった。

【0049】表1と表2に示した単量体組成(単量体総 量:400g)と重合開始剤(アゾビスイソブチロニト リル)を用いて上記の方法を繰り返し、各種の熱可塑性 高分子を合成した。

[0050]

【実施例1】合成例で重合した熱可塑性高分子溶液P-分を次に示す成分比で、12時間かきまぜた。

p - ジメチルアミノ安息香酸エチル(I - 3) マラカイトグリーン(D-1) ロイコクリスタルバイオレット (D-2) トリブロモフェニルスルホン(D-3)

MEK 次にこの混合溶液を、厚さ20μmのポリエチレンテレ

フタレートフィルム (PETフィルム) にパーコーター

を用いて均一に塗布し、90℃の乾燥機中で5分間乾燥 して光硬化性樹脂層の厚さ50μmの積層体を得た。そ い側に28μmのポリエチレンフィルム (PEフィル ム)を張り合わせて目的の光硬化性樹脂積層体を得た。 この光硬化性樹脂層の90℃における粘度は7×10° ポイズであり、365nm透過率は38%であった。 【0051】との光硬化性樹脂積層体のPEフィルムを 剥がしながら、光硬化性樹脂層を330×330×1. 6 mmの寸法の銅張り積層板に2段式ホットロールラミ ネーター(旭化成工業製「AL-700」)により12 0/160℃でラミネートした。内径が4cmのエアシ 力は6.8kg/cm' ゲージとし、ラミネート速度は 1. 0m/分とした。用いた銅張り積層板はガラス繊維 エポキシ基材の両面に18μπ銅箔を張り合わせ、直径 0.35mmの貫通孔を作り、めっきによりさらに約2 5μmの銅を析出させて両面の導通を図ったものとし た。光硬化性樹脂層の埋め込み深さは、100μmだっ

【0052】光硬化性樹脂層に、直径0.4mmの円状 の導通部を貫通孔の位置に合わせて1000個作ったネ ガフィルムを通して、超高圧水銀ランプ(オーク製作所 30 製HMW-201KB)により100mJ/cm'で露 光した。この時一方の面は、マスクをずれ幅が80μm または10μmとなるようにずらして露光し、もう一方 の面はずれないようにして露光した。マスクをずらした 場合は、スルーホールの中心とスルーホール上を覆う硬 化レジスト画像の中心を通る線上でスルーホール内壁面

3重量部

0.04重量部

0. 4重量部

0.5重量部

11重量部

からスルーホール上を覆う硬化レジスト画像の上面まで の長さをマスクずれ幅とした。

【0053】続いてPETフィルムを剥離した後、30 Cの1%炭酸ナトリウム水溶液を60秒スプレーし、未 の後、光硬化性樹脂層のPETフィルムを積層していな 10 露光部分を溶解除去した。さらに50℃の塩化第二銅溶 液を115秒スプレーし、硬化レジストの無い部分の銅 をエッチングした。スルーホール開口部被覆保持率(以 下、ずれ保持率と略記する)はマスクずれ 10 µmの場 合、100%であった。

【0054】次に50°Cの3%水酸化ナトリウム水溶液 を120秒スプレーしてレジストとして用いた硬化樹脂 膜を剥離した後テスターによりスルーホール内部の導通 を調べたところ、マスクずれ80μmの基板の断線は0 箇所(O.0%)であり、マスクずれ10 µmの基板の リンダーを用い加圧し、エアシリンダーに加えたエア圧 20 断線は0箇所(0.0%)であった。同様の方法で、ラ ミネート速度を3.0m/分でラミネートしたところ、 埋め込み深さは、30μmであり、エッチング後のずれ 保持率は100%であった。さらにレジスト剥離後の導 通は、マスクずれ80μmの場合、10箇所(1.0 %) であり、マスクずれ10 µmの場合、0箇所(0. 0%) であった。

[0055]

[実施例2~9および比較例1~7]表3~6に示した 組成を用いた以外は実施例1と同様にして、積層板およ び配線板を得た。なお、表3~6に示す組成の略号は、 熱可塑性高分子については表1~2に、他の成分につい ては実施例 1 および以下に示すものである。

【0056】1-4:ミヒラーズケトン [0057] 【表1】

						16	5	
		P — 1	P-2	P-3	P - 4	· P = 5	P-6	P - 7
	メタカリルで変	25	25	25	25	25	25	25
<u> </u> 	えチレン	25	25	25	25	40	25	15
	メタクリル酸 メチル	40	45	40	49	35	50	60
半型体组成	メナクリル役 2-とト ロキシェテル	10						
(選星%)	7/10=01/4		5					
	メタクリルでは n-フ' チル		•	10				
	N-ブ トキシメチル フクリルフミド				1			
	7かりが設 n-7' <i>手</i> が							
	7クリル酸 2-エテルヘキシル							
更合開始剂 初期仕込量	AIBN (ppr)	1.0	0.6	1.0	0.6	1.25	0.6	0.6
重合結果		良好	良好	良好	良好	残存モノマー 具 大	良好	良好
深度	(%)	36	36	37	36	35	37	· 36
重要平均分子量	×10 ⁴	4.8	7.3	5.3	4.9	3.3	5.5	5.7
Tg	(3)	130	1 25	116	128	127	128	129

[0058]

30 【表2】

	17	.			-11-7		18
		P-8	P — 9	P-10	P-11	P-12	P — 1 3
j	メナケリル酸	25	2.5	25	· 25	25	25
	スチレン	7.5	4	25			
	1999A設 15A	67.5	71	40	6.5	60.	65
単重体組成	メタクリル な 2-ヒト [・] ロキシェチル						
(重型%)	7690209#						
	メタクリル設 n−プチル						10
	N-ブ トキシメチル フタリルフミト			•			
. i	7クリル酸 n-7° チル			10	10		
•	7クリル酸 2-エチルヘキシル					15	
望合開始別 初期仕込量	ABN (ppr)	0.6	0.6	1.0	1.0	0.6	0.6
英合 結果		良好	良好	良好	良好	良好	良好
洪皮	(%)	36	36	36	39	30	37
重量平均分子 愛	×10 ⁴	4.1	4.5	5.3	4.1	6.3	5.0
Τg	(7)	129	129	100	101	89	117

[0059]

【表3】

20

		実施例 1	突施例2	実施例3	実施例4
			1		
		P-1(144)			P-2(142)
		M-1(10)	P-1(144)	P-1(144)	M-1(10)
		M-2(22)	M-1(10)	M-1(10)	M-2(23)
		M-3(10)	M-2(22)	M-2(22)	M-3(10)
	I 成	F1(5)	M-3(10)	M-3(10)	⊦1 (5)
		F2(0.3)	⊬ 1(5)	£1(5)	· +2(0.3)
() ¢	は重量部	F3(3)	D-1(0.04)	D-1(0.04)	⊦ 3(3)
		D-1 (0.04)	D-2(0.4)	D-2(0.4)	D-1(0.04)
	:	D-2(0.4)	D-3(0.5)	0-3(0.5)	D-2(0.4)
		D-3(0.5) MEK(11)	MEK(8)	MEK(B)	D-3(0.5) MEK(12)
		MCK(11)	ļ		MEK(12)
•					
然可塑性高分	7 のTg (℃)	130	130	130	125
90℃の桁段	羑 (ポイズ)	7×10 ³	6×10 ³	7×10 ³	9×10 ³
厚み ((μm)	50	50	40	50
3 6 5 n m ž	透過率 (%)	38	68 `	46	38
プレスフロ	— (μm)	700	720	560	780
	ラミネ	一十速度 1	m/分		
埋め込み課	さ (µm)	100	100	80	90
マスクずれ10μm		100	100	100	100
スルーホール新線率	マスクずれ10μm	0.0	0.0	0.0	0.0
(%)	マスクずれ80μm	0.0	0.0	0.1	0.0
	ラミネ	一卜選度 3	m/ 分	······································	
埋め込み深	さ (μm)	30	30	15	20
マスクずれ10μmのずれ保持率(%)		100	100	100	100
スルーホール断線率	マスクずれ10μm	0.0	0,0	0.0	0.0
(%)	マスクずれ80μm	1.0	0.0	12.0	12.0
	·				

[0060]

【表4】

组织()内侧	式は重量部	P-3(141) M-1(10) M-2(22) M-3(10) +1(5) +2(0.3) +3(3)	P-4(147) M-1(10) M-2(23) M-3(10) +1(5) +2(0.3)	P-6(135) M-1(10) M-2(24) M-3(10) F1(5)	P-7(139) M-1(10) M-2(24) M-3(10)
		M-1(10) M-2(22) M-3(10) +1(5) +2(0.3)	M-1(10) M-2(23) M-3(10) F1(5)	M-1(10) M-2(24) M-3(10)	M-1(10) M-2(24)
		M-1(10) M-2(22) M-3(10) +1(5) +2(0.3)	M-1(10) M-2(23) M-3(10) F1(5)	M-1(10) M-2(24) M-3(10)	M-1(10) M-2(24)
		M-1(10) M-2(22) M-3(10) +1(5) +2(0.3)	M-1(10) M-2(23) M-3(10) F1(5)	M-1(10) M-2(24) M-3(10)	M-1(10) M-2(24)
		M-2(22) M-3(10) +1(5) +2(0.3)	M-2(23) M-3(10) ⊢1(5)	M-2(24) M-3(10)	M-2(24)
		M-3(10) +1(5) +2(0.3)	M-3(10) +1(5)	M-3(10)	, , ,
		F2(0.3)			
() 內(電量型は		F2(0.3)		F1(5)
()内	は重量部	12/21	(0.0)	F2(0.3)	F2(0.3)
	i		⊢3(3)	F3(3)	F3(3)
		D-1 (0.04)	D-1 (0.04)	D-1(0.04)	D-1(0.04)
		D-2(0.4)	D-2(0.4)	D-2(0.4)	D-2(0.4)
		D-3(0.5) MEK(14)	D-3(0.5) MEX(9)	D-3(0.5)	D-3(0.5)
		PILK(14)	PICK(3)	MEK(18)	MEK(14)
	Ì				
熱可塑性高分子のTg (℃)		116	128	128	129
9 0 ℃の粘度	(ポイズ)	1×10 ⁴	5×10 ⁴	7×10 ³	1×10 ⁴
厚み(μ	rw)	50	SO	50	50
· 365nm透	過率 (%)	38	38	38	38
プレスフロー	- (μm)	780	500	720	550
	ラミネ	一卜速度 11	m/分		
埋め込み深さ	(μm)	84	70	110	85
マスクずれ10μmの)ずれ保持率 (%)	100	100	100	100
スルーホール断線率	マスクずれ10μm	0.0	0.0	0.0	0.0
(%)	マスクずれ80μm	0.1	0.3	0.0	0.0
	ラミネ	一卜速度 3 m	n/分		
埋め込み深さ	(μm)	20	18	30	20
マスクずれ10μmのずれ保持率(%)		100	95	100	100
スルーホール断線率	マスクずれ10μm	0.0	0.0	0.0	0.0
(%)	マスクずれ80μm	22.0	30.0	0.0	25.0

[0061]

		真斑例 9	比較例1	比較例 2	比較例3
			ļ		
		D 0(1.70)	0.0/2.20	0.16(1.20)	
		P-8(139) M-1(10)	P-9(139) M-1(10)	P-10(139)	P-11(133)
		M-1(10) M-2(24)	M-2(24)	M-1(10) M-2(24)	M-1(10) M-2(22)
		M-3(10)	M-3(10)	M-3(10)	M-2(22) M-3(10)
1	. 载	F1(5)	14 3(10) 1-1(5)	F1(5)	H1(5)
-		F2(0.3)	+2(0.3)	F2(0.3)	F2(0.3)
() A	は重量部	⊬3(3)	⊢3(3)	F3(3)	F3(3)
		D-1 (0.04)	D-1 (0.04)	D-1(0.04)	D-1(0.04)
1		D-2(0.4)	D-2(0.4)	D-2(0.4)	D-2(0.4)
		D-3(0.5)	D-3(0.5)	D-3(0.5)	D-3(0.5)
		MEK(14)	MEK(14)	MEK(14)	MEK(22)
}					
熱可塑性高分	FのTg (℃)	1 29	129	100	101
90℃の私間	と (ポイズ)	2×10 ⁴	3×10 ⁴	7×10 ³	7×10 ⁴
草み (μm)	50	50	50	50
3 6 5 n m ž	5通率(%)	38	38	38	38
ブレスフロー (μm)		550	900	1000	400
	ラミネ	トート速度 1	m/ /)		
埋め込み深	さ (μm)	80	80	110	50
マスクずれ10μm	のずれ保持事(%)	100	100	100	50
スルーホール断線率	マスクずれ10μm	0.0	0.0	0.0	0.0
(%)	マスクずれ80μm	0.1	0.0	0.0	0.0
	ラミネ	一卜選農 3.	m/分		
埋め込み深	さ (µm)	15	27	30	5
マスクずれ10 μmのずれ保持率 (%)		100	100	100	35
スルーホール断線率	マスクずれ10μm	0.0	0.0	0.0	14.0
(%)	マスクずれ80μm	12.0	1.0	0.0	65.0

[0062]

		(= .)			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
25					26		
		比較例 4	比较努5	比較例6	比較例7		
	B成 Bは富量部	P-11(128) M-1(10) M-2(24) M-3(10) F1(5) F2(0.3) F3(3) D-1(0.04) D-2(0.4) D-3(0.5) MEK(25)	P-11(128) M-1(10) M-2(24) M-3(10) F1(5) F4(0.11) D-1(0.04) D-2(0.4) D-3(0.5) MEK(25)	P-12(173) M-1(10) M-2(22) M-3(10) F1(5) F2(0.3) F3(3) D-1(0.04) D-2(0.4) D-3(0.5)	P-13(135) M-1(10) M-2(22) M-3(10) H1(5) H2(0.3) H3(3) D-1(0.04) D-2(0.4) D-3(0.5) MEK(18)		
熱可製性高分	子のTg (℃)	101	101	89	117		
90℃の私	変 (ポイズ)	2×10 ⁴	8×104	2×10 ⁴	1×10 ⁴		
厚み	(μm)	50	50	50	50		
3 6 5 n m	透過率(%)	38	18	38	38		
プレスフロ	(μm)	750	630	320	950		
	ラミ	1 我感イーイ	m/分 .				
埋め込み深さ(μm)		80	55	30	85		
マスク ずれ1 0μm	のずれ保持率 (%)	100	70	100	100		
スルーホール断線率	マスクずれ 1 0 μm	0.0	4.0	0.0	0.0		
(%)	マスクずれ80μm	0.0	15.0	8.0	0.0		
	ラミネート選撲 3 m/分						
埋め込み深	さ (µm)	10	10	5	20		
マスクずれ10μm	のずれ保持率(%)	50	15	22	100		
スルーホール断線率	マスクずれ 10 μm	5.0	70.0	20.0	0.0		

[0063]

【発明の効果】本発明の光硬化性樹脂積層体は、マスク と貫通孔の位置がずれた場合でも、良好なテンティング 膜を形成し、エッチング液の貫通孔内への入り込みを防 ぎ、かつ感度および解像度が良いため、近年の小径スル ーホールを利用した髙密度プリント配線板の製造に有利 に利用できる。

(%)

マスクずれ80μm

【図面の簡単な説明】

*【図1】貫通孔の内周縁部から内壁上に樹脂層が形成さ れた状態を示す概略拡大断面図である。 【符号の説明】

12.0

1 絶縁板

100.0

2 絶縁板の両面に形成された導体層

0.08

- 3 貫通孔
- 絶縁板の両面に積層された光硬化性樹脂層

***40**

40.0

[図1]

